# 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

## 氧化鉭/碳粉之碳熱還原反應動力學研究

計畫類別: 個別型計畫 整合型計畫 計畫編號:NSC 89 - 2214 - E - 164 - 001 執行期間:89 年 8 月 1 日 至 90 年 7 月 31 日

- 計畫主持人:劉宗宏 助理教授
- 共同主持人:陳素貞 資深講師

本成果報告包括以下應繳交之附件:

- 赴國外出差或研習心得報告一份
- 赴大陸地區出差或研習心得報告一份
- 出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位:私立修平技術學院(原樹德工商專科學校)化學工程科

中華民國九十年八月一日

## 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

氧化鉭/碳粉之碳熱還原反應動力學研究

Kinetics Studies on the Carbothermal Reduction Reaction of Tantalum Oxide and Carbon

計畫編號:NSC 89-2214-E-164-001 執行期限:89年8月1日至90年7月31日 計畫主持人:劉宗宏<sup>·</sup> 修平技術學院 化學工程科 助理教授 共同主持人:陳素貞 修平技術學院 化學工程科 資深講師 計畫參與人員:陳國誠、王詩欣、林士棻 修平技術學院 化學工程科 兼任助理

## 一、中文摘要

本研究以碳熱還原法並利用熱重分析 反應系統,探討各項操作變數對氧化鉭/碳 粉之反應影響。研究結果發現增加樣品的 壓結壓力、C/Ta2O5的莫耳數比、及反應溫 度,可增加碳熱還原反應的速率。但增加 樣品載量、氧化鉭及碳粉的粉粒大小,對 反應有不利的影響。實驗也發現氣體流率 對反應的影響並不明顯。實驗所得之產物 主要為細小顆粒狀的碳化鉭結晶。反應所 得之活化能為 248±10 kJ/mol。研究中亦針 對本反應系統推導一合理假設的動力模 式,在產物層擴散控制的情況下,結果與 實驗所得相當吻合。

關鍵詞:氧化鉭、碳粉、碳熱還原、動力學、碳化鉭

## Abstract

The carbothermal reduction kinetics of tantalum oxide and carbon was studied by a thermal gravimetric analysis technique. The reaction rate was increased with an increasing sample-forming pressure, C/Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> molar ratio and reaction temperature. But, the reaction rate was decreased with an increasing sample loading, the size of Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and C. The effect of gas flowrate on the reaction rate is not obvious. The observed activation energy was 248+10 kJ/mol. A kinetic model expression of the reaction process was developed, and it correlated sufficiently with observed experimental results.

**Keywords:** Tantalum oxide, Carbon, Carbothermal reduction, Kinetics, Tantalum carbide.

## 二、計畫緣由與目的

碳化鉭(TaC)具有質地堅硬、機械強 度高、質輕密度低、熱膨脹係數小、耐磨 損及化學穩定高等優點。其主要用途是作 耐磨及耐腐蝕之工模與工具、機械承軸、 耐熱坩鍋、切削工具和塑模、及堅固之碳 化工具。此外,將碳化鉭、碳化鎢、碳化 鈦與鈷之混和物,經高溫燒結,可製造出 硬度更高、耐磨性優異、抗壓強度高及極 佳耐衝擊性能之超硬合金。

一般工程陶瓷機件的製造過程中,粉末 製備是精密陶瓷的基礎,要有優良的精密 陶瓷製品,必須有精純優良的原料粉體。 因此本研究之目的即為尋求適當的反應條 件,以製得高純度的碳化鉭粉末。

有關以氧化鉭製造碳化鉭之反應,於 文獻中僅部份操作條件被探討,並未提供 完整之實驗數據。此外,本人在近幾年來 曾經探討有關二氧化矽/碳粉、熱解後稻殼 之碳熱還原氮化反應動力學,及以矽粉製 造氮化矽之動力學研究[1-4],這些結果皆 可作為本研究的實驗基礎。

## 三、研究方法

3.1 樣品的製備

本研究以高純度氧化鉭( $Ta_2O_5$ )當主 原料,並以碳黑(Carbon black)作為碳源。 將樣品經研磨、篩選,以適當比例進行混 合、壓片,製成實驗所需之反應物。

<sup>\*</sup> E-mail: liouth@mail.hit.edu.tw

#### 3.2 實驗裝置及程序

實驗是以熱重分析法(TGA),探討 氧化鉭在無氧的環境下各項操作條件之碳 熱還原反應的影響,實驗裝置如 Fig. 1 所 示。將製作好的樣品置於熱重分析儀中, 探討系統各變數(如:氣體流率、樣品載 量...等)對反應的影響。研究中並配合各 種物理分析(如:X-射線繞射儀、掃描式 電子顯微鏡...等),分析各項操作條件對 試樣之結構、晶態、及元素含量的影響, 以期提供各種實驗結果之佐證。由上述所 得之資料,進行動力學分析,求得反應速 動力學模式。

3.3 定量分析

氧化鉭之碳熱還原的總反應式為:

 $Ta_2O_{5(s)} + 7C_{(s)} = 2TaC_{(s)} + 5CO_{(g)}$ 利用此式可推導出氧化鉭/碳粉進行碳熱還 原反應生成碳化鉭之計算公式為:

$$X_T = \frac{(M_T + mM_C)\Delta W_P}{(M_T + 7M_C - 2M_T)W_P^0}$$

其中, $X_T$ 為氧化鉭之轉化率,m為C/Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的莫耳數比, $M_T$ 、 $M_C$ 、 $M_n$ 分別為氧化鉭、 碳粉、及碳化鉭之分子量。

#### 四、結果與討論

#### 4.1 物性的觀察

Fig. 2 為樣品在反應前後之 X-射線繞 射分析結果。其中,上圖為氧化鉭,是屬 於高結晶性物質。中間圖為碳粉,是屬於 非結晶型物質。下圖為反應後之樣品,主 要為碳化鉭及部份未反應完之氧化鉭。

Fig. 3 為樣品在反應前後之掃描式電 子顯微鏡分析結果。其中,圖(a)為氧化鉭, 是由不規則之顆粒所組成。圖(b)為碳粉, 具有多孔洞之表面。圖(c)為反應後之樣 品,仍保有多孔性的表面。圖(d)為碳化鉭 產物,為細小顆粒狀的結晶。此結果與 Zhang et al.[5]所觀察到的產物型態相似。

#### 4.2 反應條件的探討

在氣體流率的影響方面,由 Fig.4 可 知,增加氣體可增加氧化鉭的轉化率,但 就整體而言,氣體流率對轉化率的影響並 不明顯。在樣品載量的影響方面,由 Fig.5 可知,減少樣品的載量,可增加氧化鉭之 轉化率,但當載量小於 8mg 時,轉化率所

#### 受之影響較不明顯。

在壓片壓力的影響方面,由 Fig.6 可 知,當壓片壓力愈大時,碳與氧化鉭間的 距離就越接近,結果將使反應增快,但當 壓力超過 1x10<sup>5</sup> kPa 時,對反應的影響較不 明顯。在碳粉/氧化鉭之莫耳數比的影響方 面,由 Fig.7 可知,提高莫耳數比確實可增 加氧化鉭的轉化率,但當莫耳數比大於 10 時,其影響漸減。Shimada et al.[6]亦得到 相同的結論。

在氧化鉭粉粒大小的影響方面,由 Fig.8 可知,減少氧化鉭的粉粒大小,可提 高氧化鉭的轉化率,但當直徑小於53 μm 時,對反應無明顯影響。在碳粉粉粒大小 的影響方面,由 Fig.9 可知,減少碳粉粉粒 大小將增加反應速率,但當直徑小於53 μ m時,對反應的影響較不明顯 Choi et al.[7] 認為此結果與比表面積之增加有很大的關 係。

在反應溫度的影響方面,由 Fig.10 可 知,提高溫度將增加碳熱還原反應的速 率,而且溫度對反應的影響相當敏感。此 結果與 Johnsson[8,9]所得之結論相同。

#### 4.3 反應動力學的研究

此碳熱還原反應系統,於去除質傳阻 力的影響下,其反應式可表示為:

$$-r_{T} = -\frac{1}{W_{T}^{0}} \frac{dW_{T}}{dt} = f(k, m, P_{f}, d_{T}^{0}, d_{C}^{0})$$

其中,- $r_T$ 為氧化鉭之碳熱還原反應速率;  $W_T^0$ 為反應前氧化鉭之初始重量; $W_T$ 為時間t時,氧化鉭之重量;k為反應速率常數。 在適當之 C/Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>莫耳數比、壓片壓力、 氧化鉭與碳粉之粉粒大小下,對反應影響 不明顯,故上式可簡化,並表示成 Arrhenius 型態之方程式:

$$-r_{T}^{0} = f(k) = k_{0} \exp(-E/RT)$$

將上式取自然對數,並利用 ln(-r<sub>T</sub><sup>0</sup>)對(1/T) 作圖,可得 Fig.11。經由此圖可得反應所 需之活化能為 248±10 kJ/mol,此活化能值 比 Shimada et al.[6]所獲得之值(391 kJ/mol)低。因此氧化鉭之碳熱還原反應速 率表示式可寫成:

$$-r_{T} = 7.096 \times 10^{4} \exp(\frac{-248 \times 10^{3}}{RT}) mg/mg s$$

## 4.4 反應模式的探討

假設試樣是由成分均勻的金屬氧化物 與碳粉晶粒所組成,在反應過程中晶粒的 幾何形狀保持不變,且晶粒本身具非孔隙 性。在產物層擴散控制的情況下,此時試 樣之反應速率可表示為:

$$-4fr^2 D_e \frac{dC_n}{dr} = C$$

其中,  $C_n$  為反應過程中, 某氣體中間物之 濃度,  $D_e$ 為擴散係數, r 為氧化鉭之晶粒半 徑。將邊界條件( $r = r_c$ 時 $C_n = 0$ ,  $r = r_0$ 時  $C_n = C_n^0$ )代入上式, 並積分可得  $C_1$ 之值, 因此上式可重新表示成:

 $\frac{3}{2}4fr^{2}D_{e}\frac{dC_{n}}{dr} = \frac{3}{2}\frac{4fD_{e}C_{n}^{0}}{(1/r_{c}-1/r_{0})} = \frac{6fD_{e}C_{n}^{0}}{(1/r_{c}-1/r_{0})}$ 令 W<sub>T</sub> = 4/3 <sub>T</sub> Nr<sub>c</sub><sup>3</sup>, 並將氧化鉭轉化率 之定義代入上式並積分,可得氧化鉭之轉 化率對反應時間的關係為:

$$1-3(1-X_T)^{2/3}+2(1-X_T)=k_1T$$
  
其中

$$k_1 = \frac{12fC_n^0 D_e NM_T}{(4/3 \dots TfN)^{1/3} (W_T^0)^{2/3}}$$

將實驗數據作圖,結果如 Fig.12 所 示。從圖中發現在不同溫度下,利用此模 式所表示之實驗數據,所得結果皆為一直 線,因此可知此氧化鉭/碳粉之碳熱還原反 應系統可以此模式表示之。

#### 五、計畫成果自評

由實驗結果可知,本研究與原計畫內容 相符,並已達成預期的目標。此研究成果之 學術與應用價值有:可提供氧化鉭/碳粉之 碳熱還原過程之可能最佳反應操作條件,建 立反應速率式與動力學模式,供程序設計之 參考,及提供其它有關碳熱還原反應過程中 所需之基本資料。

由於碳化鉭是各項精密工業發展之重 要原料,尤其是在高溫耐熱及耐磨損元件 的應用上更顯重要,因此本研究之成果非 常適合發表在學術期刊或相關專利上。

#### 六、參考文獻

[1]Liou, T. H., and F. W. Chang, Ind. Eng. Chem. Res., 34(1), 118(1995).

- [2]Liou, T. H., and F. W. Chang, Ind. Eng. Chem. Res., 35(10), 3375(1996).
- [3]Liou, T. H., F. W. Chang, and J. J. Lo, Ind.

Eng. Chem. Res., 36(3), 568(1997)

- [4]Chang, F. W., T. H. Liou and F. M. Tsai, Thermochim. Acta, 354,71 (2000).
- [5]Zhang, Q. Y., X. X. Mei, D. Z. Yang, F. X. Chen, T. C. Ma, Y. M. Wang and F. N. Teng, Nucl. Instrum. Methods Phys. Sect. B., 127/128, 664(1997).
- [6]Shimada, S., T. Koyama, K. Kodaira and T. Mastushita, J. Mater. Sci., 18, 1291(1983).
- [7]Choi, J. G., H. G. Oh and Y. S. Baek, J. Ind. Eng. Chem., 4(2), 94(1998).
- [8]Johnsson, M. and M. Nygren, J. Mater. Res., 12(9), 2419(1997).
- [9]Johnsson, M., N. Ahlen, M. Nygren, M. Ekelund, and G. Brandt, U.S. Patent US5851285.





Figure 1 Schematic diagram of the apparatus.



Figure 2 X-ray diffractogram.



Figure 3 Scanning electron micrographs of the specimen.



Figure 4 The effect of gas

flow rate on the reaction of

sample.

0.8



Figure 7 The effect of  $C/Ta_2O_5$  molar ratio on the reaction of sample.



Figure 10 The effect of reaction temperature on the reaction of sample.



Figure 5 The effect of sample loading on the reaction of sample.



Figure 8 The effect of grain size of tantalum oxide on the reaction of sample.



Figure 11 Arrhenius plot of the initial reaction rate of tantalum oxide.



Figure 6 The effect of sample-forming pressure on the reaction of sample.



0.30 1398 K 1423 K 1448 K 1473 K 1498 K 0.25 1-3(1-X)<sup>2/3</sup>+2(1-X) 0.20 1523 K 1548 k 0.15 0.10 0.05 Time (min)

Figure 9 The effect of grain size of carbon on the reaction of sample.

5

Figure 12 Experimental data plotted according to the kinetic model.